PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-104960

(43)Date of publication of application: 17.04.2001

(51)Int.CI.

CO2F 1/469 BO1D 61/48

C02F 1/42

(21)Application number: 11-287044

(71)Applicant: KURITA WATER IND LTD

(22)Date of filing:

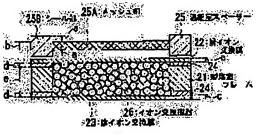
07.10.1999

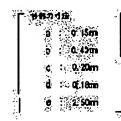
(72)Inventor: IWASAKI KUNIHIRO

(54) ELECTRIC DEIONIZING APPARATUS

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To stably and certainly obtain treated water of high quality by improving the packed state of an ion exchanger in the desalting chamber of an electric deionizing apparatus. SOLUTION: The desalting chamber of an electric deionizing apparatus is packed with an ion exchanger so that the volume of the ion exchanger at a time of the passage of water becomes 101-120% of the volume the desalting chamber.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

28.09.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] Searching PAJ Page 2 of 2

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出席公開母号

特開2001-104960

(P2001-104960A)

(43)公顷日 平成13年4月17日(2001.4.17)

(51) Int.CL'		裁別配号	ΡI	テーマコード(参考)
C02F	1/469		BOID 61/48	4D006
B01D	61/48		C 0 2 F 1/42	2ABA 4D025
C 0 2 P	1/42	ZAB	1/46	103 4D061

審査部界 京部界 第項の数2 OL (全 5 頁)

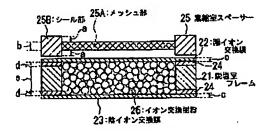
工業株式会社内 (74)代望人 100088911	(21)出國番号	物顧平11-287044	(71)出頃人 000001063 栗田工業株式会社
BA25 1405 DA06 4D061 DA01 DB13 EA09 EB04 EB13 EB18 FA08 CC20			東京都新宿区西新宿 3 丁目 4 番 7 号 (72) 発明者 岩崎 邦博 東京都新宿区西新宿三丁目 4 番 7 号 栗田 工業株式会社内 (74) 代憩人 10008 6911

(54) 【発明の名称】 電気脱イオン装置

(57)【要约】

【課題】 電気脱イオン装置の脱塩室におけるイオン交 後体の充填状態を改善するととにより、高水質の処理水 を安定かつ確実に得る。

【解決手段】 イオン交換体の通水時容積が脱塩室容積 の101~120%となるように、電気脱イオン鉄置の 脱塩室にイオン交換体を充填する。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 除極を備えてなる陰極室と隔極を備えて なる陽極室との間に陰イオン交換膜と陽イオン交換膜と を交互に配列して脱塩室と造縮室とを形成し、該脱塩室 にイオン交換体を充填した電気脱イオン装置において、 該イオン交換体の通水時容積が該脱塩室容積の101~ 120%であることを特徴とする電気崩イオン装置。 【請求項2】 請求項1において、該顧塩室に充填され るイオン交換体の乾燥時容積が該脱塩室の容積の80~ 95%であることを特徴とする電気脱イオン装置。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、陰極と陽極との間 に、複数のアニオン交換膜とカチオン交換膜とを交互に 配列して濃縮室と脱塩室とを交互に形成してなる電気脱 イオン装置(電気再生式脱イオン装置)に係り、特に、 この電気脱イオン装置の脱塩室に充填するイオン交換体 の充填密度を改善して、得られる脱イオン水の水質を高 めた電気脱イオン装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、半導体製造工場、液晶製造工場、 製薬工業、食品工業、電力工業等の各種の産業ないし研 究ែ設等において使用される脱イオン水の製造には、イ オン交換樹脂のような再生を必要とせず、完全な連続採 水が可能で、極めて高純度の水を効率的に得ることがで きるという使れた特長を備えることから、電気脱イオン 装置が多用されている。

【0003】電気脱イオン装置は、電極同士の間に複数 のカチオン交換膜とアニオン交換膜とを交互に配列して 脱塩室と濃縮室とを交互に形成し、脱塩室にイオン交換 30 体を充填した構成を有する。この電気脱イオン装置にあ っては陽径、陰極間に弯圧を印加しながら脱塩室に彼処 選水を流入させると共に、 治縮室に治縮水を流入させ彼 処理水中の不純物イオンを除去し、脱イオン水を製造す

【0004】図2はこの電気脱イオン装置の基本的な構 成を示す分解図である。

【0005】陰極側のエンドプレート1に沿って陰極電 極板2が配置され、この陰極電極板2の風縁部に枠状の 陰極用スペーサー3が重ね合わされる。この陰極用スペ 40 -ーサー3の上にカチオン交換膜4、脱塩窒形成用の枠状 フレーム5、アニオン交換膜6及び遺稿室形成用の枠状 フレーム7がこの順に重ね合わされる。このカチオン交 換職4、脱塩室形成用の枠状フレーム5、アニオン交換 膜6及び濃縮室形成用の枠状プレーム7が1単位として 多数重ね合わされる。即ち、膜4、フレーム5、膜6、 フレーム7が連続して繰り返し綺麗される。最後のアニ オン交換膜6に対し枠状の陽極用スペーサー8を介して 院征電極板9が重ね合わされ、その上に院極側エンドブ レート10が重ね合わされて満層体とされる。この満層 50 に配列して脱塩室と濃縮室とを形成し、該脱塩室にイオ

体はボルト等によって締め付けられる。

【0006】上記の脱塩室用フレーム5の内側スペース が関塩室となっており、この脱塩室にはイオン交換制脂 等のイオン交換体5 Rが充填される。また、濃縮室用フ レーム7の内側スペースが遺植室となっている。この濃 縮室にはメッシュスペーサー7Mなどが配置される。 【0007】とのような装置にあっては、院径9と陰径

2

2の間に直流電流を通じ、且つ彼処理水 (原水)を彼処 **理水流入ライン 1 1 を通して脱塩室内に通水せしめ、ま** 10 た、遺館水を遺稿水流入ライン12を通じて濃縮室内に 通水せしめる。民塩室内に流入してきた彼処理水はイオ ン交換樹脂の充填層を流下し、その際、鉄紋処理水中の 不純物イオンが除かれて脱イオン水となり、これが脱イ オン水流出ライン13を経て流出する。

【0008】一方、濃縮室内に通水された濃縮水は濃縮 室内を流下するときに、イオン交換膜4,6を介して移 動してくる不純物イオンを受け取り、不純物イオンを読 縮した滤縮水として濃縮水流出ライン14より流出す る。電極室にはそれぞれ導入ライン15、16及び取出 20 ライン17.18を介して電極水が流道される。

【0009】特誦平10-216729号公報には、こ のような電気脱イオン装置において、電気抵抗を小さく して処理の安定化を図るべく、脱塩室内に充填したイオ ン交換体とイオン交換膜との間に0.1~20kg/c m³ の圧力を発生させて、イオン交換体相互及びイオン 交換体とイオン交換膜との密着性を上げることが記載さ れている。そして、同公報には脱塩室に充填するイオン 交換体を再生型の容論より容論を減少させた形に変換 し、自由状態でのイオン交換体再生型容積が脱塩室容積 に対して103%~170%となる量のイオン交換体を 充填することが記載されている。ただし、同公報では、 通水時(使用状態)におけるイオン交換体の容積につい ては検討されていない。

[0.01.0]

【発明が解決しようとする課題】しかし、特闘平10-216729号公銀に記載されるように、自由状態での イオン交換体再生型容績が脱塩度容債に対して103~ 170%となるようにイオン交換体を充填しても、必ず しも良好な水質の処理水が得られるわけではなく、処理 の安定性の面で問題があった。

【0011】本発明は上記従来の問題点を解決し、電気 脱イオン装置の脱塩室におけるイオン交換体の充填状態 を改善することにより、高水質の処理水を安定かつ確実 に得ることができるようにした電気脱イオン装置を提供 することを目的とする。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明の電気脱イオン藝 置は、陰極を備えてなる陰極室と陽極を備えてなる陽極 室との間に、除イオン交換膜と陽イオン交換膜とを交互

ン交換体を充填した電気脱イオン装置において、酸イオ ン交換体の通水時容積が該脱塩室容積の101~120 %であることを特徴とする。

【0013】なお、以下において、脱塩室に充填された イオン交換体の道水時の容積(このイオン交換体の容積 は、道水時の脱塩室の容積に相当する。)の、脱塩室容 領(この脱塩室容詞とは、イオン交換体を充填する前の 脱塩室の容韻である。)に対する割合(百分率)を「通 水時容積率」と称す場合がある。

と、イオン交換体同士及びイオン交換体とイオン交換膜 との独点数が増え、脱塩室内でのイオンの移動が容易に なり、処理水の比抵抗が向上する。また、このようにイ オン交換体の充填密度を高めると、遺稿室もスペーサー を介して脱塩室のイオン交換体の彫澗により圧縮される ことにより、脱塩室から造宿室へのイオンの移動が速く なり、脱塩が円滑に進行し、このことによっても、処理 水の比抵抗が向上する。

【0015】しかし、特開平10-216729号公銀 に記載されるように自由状態で脱塩室容績に対して10 20 3~170%のイオン交換体を充填すると過充填となっ て脱塩室の圧力損失が増え、処理水量が低下する上に、 **遠宿室スペーサーのシールが不十分となる問題があり、** 処理水の比抵抗が低下する場合がある。

【0016】本発明では、道水時容積率が101~12 0%となるように脱塩室にイオン交換体を充填するた め、比抵抗18MQ・cm以上の処理水を安定かつ確実 に得ることができる。

【0017】このような本発明の電気脱イオン装置は、 吸水により膨潤すると乾燥時の110~130%程度に 30 容積が大きくなるようなイオン交換体を用い、このイオ ン交換体を乾燥状態で、脱塩室の容積に対して80~9 5%(以下、この割合を「乾燥充填率」と称す場合があ る。)となるように、脱塩室に充填して通水時容積率が 101~120%、好ましくは110%程度となるよう にして作製するのが好ましい。

[0018]

【発明の真施の形態】以下に本発明の実施の形態を詳細

【① ① 19】本発明の電気脱イオン鉄圏は、通水時容積 40 率が101~120%となるように脱塩度にイオン交換 体を充填すること以外は、図2に示す一般的な電気脱イ オン装置と同様の構成とされている。

【0020】この通水時容積率が101%未満では、イ オン交換体の充填置が不足して十分に比抵抗の高い処理 水を得ることができない。 道水時容積率が120%を超 えるとイオン交換体の充填量が多過ぎて、濃縮室スペー サーのシールが不十分となり、やはり処理水の比抵抗が 低下する。従って、通水時容積率は101~120%、 特に105~115%、とりわけ110%程度となるよ 50 塩室の容詞は665mm×(2.5+0.18+0.1

うに充填するのが好ましい。

【0021】このような電気脱イオン鉄置を作製するに は、吸水により膨沥すると乾燥時の110~130%程 度に容益が大きくなるようなイオン交換体を用い、この イオン交換体を関塩室に乾燥充填率80~95%となる ように充填し、道水時の膨潤状態において通水時容積率 が101~120%となるようにするのが好ましい。

【0022】このような充填率で脱塩室にイオン交換体 を充填すると、電気脱イオン装置の追水使用時にはイオ 【0014】脱塩室のイオン交換体の充填密度を高める 10 ン交換体の吸水による膨潤で脱塩室を仕切るイオン交換 膜は治脑室側に膨らんで、脱塩室はイオン交換体充填前 の厚みよりも厚みが増すことになるが、この厚みの増加 登は、各々濃縮室側にO. 1~1. 0mm、台計でO. 2~2. Omm程度であることが好ましい。

> 【0023】なお、脱塩室に充填するイオン交換体とし ては、イオン交換樹脂、イオン交換機能等を用いること ができ、その充填方法には特に制限はなく、寫法に従っ て行うことができる。例えば、イオン交換樹脂をメタノ ール洗浄し、真空乾燥機にかけて乾燥後、乾燥樹脂を脱 塩室に収納して電気脱イオン装置を組み立て、その役通 水して勧脳に水分を吸収させて膨調させる方法を採用す ることができる。

[0024]

【実施例】以下に実施例及び比較例を挙げて本発明をよ り具体的に説明する。

【0025】実施例1

イオン交換制脂として、ダウケミカル社製モノスフィア (650C、550A)を用い、陽イオン交換樹脂/陰 イオン交換樹脂=40/60 (湿潤状態での容積比)で 渡合したものを、まず、10%食塩水に浸漬して塩型に 変換した後、メタノールに浸漬して水分を溶媒置換し、 これを真空乾燥機に入れて約1.5torrで2~3時 間乾燥後、デンケーター中に保管した。

【0026】との乾燥錯脂は吸水により膨調して乾燥時 の容積に比べて129%となるものである。この樹脂を 用いて図1に示す寸法の脱塩室及び波縮室を有する電気 脱イオン装置を製作した。

【0027】電気脱イオン装置の組み立てに当っては、 まず、脱塩室フレーム21の両側に両面テープ24を貼 り、陽イオン交換膜22を貼り、次に乾燥状態のイオン 交換樹脂26を充填し、次に陰イオン交換膜23を貼っ て脱塩室の構成単位を作製した。この脱塩室の構成単位 3枚と濃縮窒スペーサー25(シール部25Bに取り付 けられたメッシュ部25Aは20メッシュ)2枚を交互 に重ねて150kgf·cmのトルクで締め付けて電気 脱イオン装置を作製し、脱塩室及び設備室に導電率8 μ s/cmの水を10分間供給してイオン交換樹脂を十分 に湿潤化させて膨稠させた。

【0028】各部材の寸法は図1に示す通りであり、脱

(4)

8) mm×28mm×4 リブ=213 ccである。 【0029】この脱塩室に乾燥したイオン交換樹脂を1 92 c c 充填した。従って、乾燥充填率は90% (= 1 92÷213×100)である。

【0030】脱塩室は通水時においては、樹脂の膨調で 両側の濃縮室側へイオン交換膜が膨らんで厚みが増え る。との通水時のイオン交換体の容積に相当する通水時 の脱塩室の容債を調べるために、電気関イオン装置の通 水後の解体の際に、樹脂を取り出す前に両側のイオン交 換職が膨らんでいる状態で脱塩室厚さ(両側のイオン交 10 【0034】実施例2,3.比較例1.2 後膜を含む)をノギスで実測し、脱塩室の厚さをノギス の実測値から両イオン交換膜の厚さを差し引いて求め た。その結果、イオン交換機にはシワがよっている部分 もあったが、ノギスの真測値は平均で3. 6 mmであ り、脱塩室の厚さは3.2mm(3.6-(0.2+

*容積は、238cc (=665mm×3. 2mm×28 mm×4リブ) であると考えられる。

【0031】従って、通水時容積率は112%(=23 8+213×100) である。

【0032】との電気脱イオン装置に導電率8μs/c m、ンリカ284ppb、pH7の水を電圧8.4V, 電流り、45Aの条件で通水して脱塩処理を行った。

【0033】とのときの処理水量及び脱塩室の圧力損失 と、得られた処理水の水質は衰1に示す通りであった。

乾燥充填率を変え、通水時容積率を表しに示す値とした こと以外は真緒例1と同様にして電気脱イオン装置を組 み立て、同様に脱塩処理を行って、得られた処理水の水 質を表1に示した。

[0035]

【表1】

(). 2)) であるとされた。従って、道水時の脱塩室の米

<i>(</i> 5)		通水時	処理水量 (L/hr)	脱塩室の 圧力損失 (kg/cm²)	処理水水質	
		容核率 (%)			比据统 (MQ·cm)	シリカ (npb)※
	1	112	40	0. 4	17. 93	6 (97. 9)
实施例	2	105	40	0. 4	17. 20	6 (97. 9)
	3	115	40	0. 35	17. 77	6 (97. 9)
比较例	1	100	40	G. 45	15	13 (95. 4)
	2	130	40	0. 6	5	45 (84. 2)

※カッコ内はシリカ除去率(%)

[0036]

【発明の効果】以上詳述した通り、本発明の電気脱イオ ン装置によれば、著しく高純度の処理水を安定かつ確実 30 6 アニオン交換膜 に製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例で製作した電気脱イオン装置の脱塩室と 濃縮室を示す断面図である。

【図2】電気脱イオン装置の一般的な構成を示す分解料 視図である。

【符号の説明】

4. カチオン交換膜

5 フレーム

5R イオン交換体

7 フレーム

7M メッシュスペーサ

21 脱塩室フレーム

22 院イオン交換膜

23 陰イオン交換膜

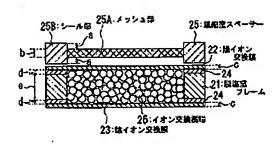
24 両面テープ

25 濃縮室スペーサー

26 イオン交換制脂

(5)

【図1】



[図2]

